

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

特許第6666672号
(P6666672)

(45) 発行日 令和2年3月18日(2020.3.18)

(24) 登録日 令和2年2月26日(2020.2.26)

(51) Int.Cl.

F 1

F 16 K 7/16 (2006.01)
 F 16 K 27/12 (2006.01)
 F 16 K 31/524 (2006.01)

F 16 K 7/16
 F 16 K 27/12
 F 16 K 7/16
 F 16 K 31/524

F

E

請求項の数 2 (全 13 頁)

(21) 出願番号 特願2015-169788 (P2015-169788)
 (22) 出願日 平成27年8月28日 (2015.8.28)
 (65) 公開番号 特開2017-44322 (P2017-44322A)
 (43) 公開日 平成29年3月2日 (2017.3.2)
 審査請求日 平成30年8月1日 (2018.8.1)

(73) 特許権者 390033857
 株式会社フジキン
 大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番2号
 (74) 代理人 100183380
 弁理士 山下 裕司
 (74) 代理人 110000279
 特許業務法人 ウィルフォート国際特許事務所
 (72) 発明者 柳田 保昌
 大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番2号
 株式会社フジキン内
 (72) 発明者 薬師神 忠幸
 大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番2号
 株式会社フジキン内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】バルブ

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

弁室および前記弁室に連通する流体通路が形成され、前記流体通路の開口部に設けられ前記弁室に向かって突出する弁座が設けられたボディと、

前記弁座に当接および離間し、前記流体通路を開閉するダイヤフラムと、

円筒状をなし、前記ダイヤフラムの周縁部を前記ボディと共に挟持するポンネットと、

前記ポンネットが延びる方向に沿って複数に分割して構成され、前記ボディに対し近接および離間可能に前記ポンネットに支持され、前記ダイヤフラムを変形可能なシステムと、

前記ポンネットに対し着脱可能に設けられるケーシングと、前記ケーシング内に設けられ前記システムを前記ダイヤフラムに向かって付勢する付勢部と、前記ケーシングをポンネットに対し係止する係止部材とを備え、前記システムを駆動するアクチュエータ部と、を備え、

前記係止部材は、ナットであり、前記ポンネットの外周に螺合され、前記ケーシングに当接し、

前記システムは、第1システムと、第2システムと、第3システムとを有し、

前記第1システムは、前記ダイヤフラムの前記アクチュエータ部側に設けられ、前記アクチュエータ部側の部分が円柱状をなし、前記ダイヤフラム側の部分がフランジ状をなし

前記第2システムは、円柱状をなし、前記第1システムの前記ダイヤフラム側に対する反対側に設けられ、

10

20

前記第3システムは、前記第2システムの前記第1システム側に対する反対側に設けられ、前記アクチュエータ部側の部分がフランジ状をなしている、バルブ。

【請求項2】

前記アクチュエータ部の前記システムを駆動する駆動部は、手動式の駆動部、自動式の駆動部、または、手動式および自動式の両方の機能を備える駆動部である請求項1に記載のバルブ。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、半導体製造装置および原子力発電プラント等の流体管路に使用されるバルブ 10 に関する。

【背景技術】

【0002】

従来より、ポンネット内にシステムを付勢するコイルばねを設け、ポンネットにシステムを駆動するアクチュエータ部を装着したバルブが提案されている。（例えば、特許文献1参照）。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【特許文献1】特開2012-026544号公報

20

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

ところで、製造プロセスの変更等により、アクチュエータ部の駆動方式を変更する場合がある。例えば、自動式のアクチュエータ部を、手動式、または、手動式および自動式の両方の方式のアクチュエータ部に交換する場合がある。

【0005】

しかし、特許文献1に記載のバルブにおいて、アクチュエータ部を交換しようとするとき、流体通路を大気開放する必要があるため、アクチュエータ部を交換した後、再稼働まで時間を要していた。

30

【0006】

そこで本発明は、流体通路の気密性を確保したまま、容易に交換可能なアクチュエータ部を備えたバルブを提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0007】

上記目的を解決するために、本発明の一態様であるバルブは、弁室および前記弁室に連通する流体通路が形成され、前記流体通路の開口部に設けられ前記弁室に向かって突出する弁座が設けられたボディと、前記弁座に当接および離間し、前記流体通路を開閉するダイヤフラムと、前記ダイヤフラムの周縁部を前記ボディと共に挟持するポンネットと、前記ポンネットが延びる方向に沿って複数に分割して構成され、前記ボディに対し近接および離間可能に前記ポンネットに支持され、前記ダイヤフラムを変形可能なシステムと、前記ポンネットに対し着脱可能に設けられるケーシングと、前記ケーシング内に設けられ前記システムを前記ダイヤフラムに向かって付勢する付勢部と、前記ケーシングをポンネットに対し係止する係止部材とを備え、前記システムを駆動するアクチュエータ部と、を備える。

40

【0008】

また、前記アクチュエータ部の前記システムを駆動する駆動部は、手動式の駆動部、自動式の駆動部、または、手動式および自動式の両方の機能を備える駆動部であっても良い。

【発明の効果】

【0009】

本発明によれば、ダイヤフラムを傷つけることなくダイヤフラムのリフト量を容易に調 50

整可能なバルブを提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【0010】

【図1】本発明の実施形態に係る閉状態にあるバルブの縦断面図を示す。

【図2】倍力機構の分解斜視図を示す。

【図3】倍力機構により作動部の力が増幅される原理についての説明図を示す。

【図4】開状態にあるバルブの縦断面図を示す。

【図5】ポンネットからアクチュエータ部を外した状態の分解図を示す。

【図6】手動式の駆動部を有するアクチュエータ部が取り付けられたバルブの縦断面図を示す。

10

【図7】手動式および自動式の両方の機能を備える駆動部を有するアクチュエータ部が取り付けられたバルブの縦断面図を示す。

【発明を実施するための形態】

【0011】

本発明の一実施形態によるバルブについて、図面を参照して説明する。

【0012】

図1は、本実施形態における閉状態にあるバルブ1の縦断面図を示している。図1に示すように、バルブ1は、ダイヤフラムバルブであり、流体制御装置のガスライン（例えば、ガスイランの最も上流側）で使用されるバルブである。バルブ1は、ボディ2と、ポンネット部10と、アクチュエータ部20とを備える。なお、以下の説明において、バルブ1の、アクチュエータ部20を上側、ボディ2側を下側として説明する。

20

【0013】

ボディ2には、円柱状の弁室2aと、弁室2aに連通する流入路2bおよび流出路2cとが形成されている。ボディ2の流入路2bと弁室2aとが連通する箇所の周縁（流入路2bの開口部）には、ポンネット部10に向かって突出する円環状の弁座2dが設けられている。

【0014】

ポンネット部10は、ポンネット11と、ポンネットナット12と、ダイヤフラム13と、押さえアダプタ14と、ダイヤフラム押さえ15、ステム16とを有する。

【0015】

30

ポンネット11は、略円筒状をなし、ポンネットナット12がボディ2に対し螺合されることにより、ボディ2に対し固定されている。ポンネット11の上端部の外周には、雄ねじ部11Aが設けられている。

【0016】

ダイヤフラム13は、複数枚のダイヤフラムにより構成され、環状の押さえアダプタ14により、その外周縁部が狭圧され、ボディ2に対し保持されている。弁体であるダイヤフラム13は、略球殻状をなし、上に凸の略円弧状が自然状態となっている。ダイヤフラム13が弁座2dに対し当接および離間することによって、流入路2bと流出路2cとの間の連通または遮断が行われる。バルブ1が閉状態にあるときには、ダイヤフラム13が弁座2dに当接し、流入路2bと流出路2cとが遮断される。図4に示すように、バルブ1が開状態にあるときには、ダイヤフラム13が弁座2dから離間し、流入路2bと流出路2cとが連通する。

40

【0017】

ダイヤフラム押さえ15は、ダイヤフラム13の上側に設けられ、ポンネット11により上下方向に移動可能に支持され、ダイヤフラム13の中央部を押圧可能である。

【0018】

ステム16は、ポンネット11を貫通するように設けられ、第1ステム17と、第2ステム18と、第3ステム19とにより構成されている。このようにステム16は、上下方向（ポンネット11が延びる方向）に沿って、複数（本実施形態では3つ）に分割して構成されている。第1～3ステム17～19において、隣り合うステムは、互いに当接して

50

いるが、連結されていない。

【0019】

第1ステム17は、ダイヤフラム押さえ15の上側に設けられ、下端部がフランジ状をなしている。第2ステム18は、円柱状をなし、第1ステム17の上側に設けられている。第3ステム19は、第2ステム18の上側に設けられ、円柱部19Aと円柱部19Aの上端に設けられた円板部19Bとにより構成される。円柱部19Aの下半分はボンネット11内に位置し、円柱部19Aの上半分および円板部19Bは、アクチュエータ部20内に位置している。

【0020】

アクチュエータ部20は、ケーシング21と、ナット22と、駆動部30と、を備える 10
。

ケーシング21は、底ケーシング23と 下ケーシング24と 上ケーシング25とにより構成される。ナット22は、ボンネット11の雄ねじ部11Aに螺合され、ケーシング21に当接することにより、ケーシング21のボンネット11に対する回動を抑制する。よって、ナット22は、回動抑制機構として機能する。ナット22を緩めることにより、ケーシング21の回動の抑制は解除される。また、ナット22をケーシング21に対し押圧させることにより、アクチュエータ部20(ケーシング21)はボンネット11に対し係止され、ナット22のケーシング21に対する押圧を解除することにより、アクチュエータ部20(ケーシング21)のボンネット11に対する係止が解除される。よって、ナット22は、アクチュエータ部20(ケーシング21)をボンネット11に対し着脱可能に係止する係止部材として機能する。 20

【0021】

底ケーシング23は、底部23Aと、底部23Aから下方に延びる円筒部23Bとにより構成される。底部23Aの中央には、貫通孔23cが形成され、貫通孔23cを囲むように、環状の凹部23dが形成されている。貫通孔23cには、第3ステム19の円柱部19Aが貫通しており、凹部23d内に、第3ステム19の円板部19Bが位置するよう構成されている。底部23Aの外周には、雄ねじ部23Eが設けられている。円筒部23Bの内周には雌ねじ部23Fが設けられ、当該雌ねじ部23Fがボンネット11の雄ねじ部11Aに螺合されることにより、底ケーシング23はボンネット11に固定されている。第10リング3Aが、底部23Aと第3ステム19の円柱部19Aとの間に介在し、第3ステム19の上下方向への移動時に径方向の移動を抑制する。 30

【0022】

下ケーシング24は、略円筒状をなし、下端部の内周に雌ねじ部24Aが設けられ、上端部の外周に雄ねじ部24Bが設けられている。下ケーシング24には、その内周面24cから内方に向かって伸び、内部空間を上下に仕切る仕切部24Dが設けられている。仕切部24Dの中央部には、貫通孔24eが形成されている。下ケーシング24は、その雌ねじ部24Aが底ケーシング23の雄ねじ部23Eに螺合されることにより、底ケーシング23に固定されている。

【0023】

上ケーシング25は、略円筒状をなし、その下端部の内周に設けられた雌ねじ部25Aを下ケーシング24の上端部に設けられた雄ねじ部24Bに螺合させることにより、下ケーシング24に固定されている。上ケーシング25には、操作エアが流入する操作エア流入路25bが形成され、操作エア流入路25bの上端部には、図示せぬ管継手を螺合するための被螺合部25cが形成されている。なお、ケーシング21において、仕切部24Dの上側にピストン収容室21aが形成され、仕切部24Dの下側に倍力機構収容室21bが形成される。 40

【0024】

駆動部30は、第3ステム19と、ピストン31と、コイルばね32と、作動部33と、倍力機構40とにより構成される。駆動部30は、自動式の駆動部である。

【0025】

ピストン31は、仕切部24Dの上側に設けられ、下ケーシング24の内周に上下方向に移動可能に支持されている。ピストン31は、略円板状をなす基部31Aと、基部31Aの中央部から上側に延びる上延出部31Bと、下側に延びる下延出部31Cとを備える。基部31Aの外周縁には、第2Oリング3Bが設けられ、第2Oリング3Bにより、基部31Aの上下方向への移動時に径方向の移動を抑制する。基部31Aの下面と仕切部24Dの上面とにより、操作エア導入室21cが形成される。第2Oリング3Bは、操作エアが操作エア導入室21cから漏れるのを防止する。

【0026】

上延出部31Bの上側部は、操作エア流入路25b内に挿入され、第3Oリング3Cにより上下方向への移動時に径方向の移動を抑制する。第3Oリング3Cは、操作エアが外部に漏れるのを防止する。ピストン31には、上延出部31Bの上端から基部31Aの下面に延び、操作エア導入室21cに連通する操作エア導入路31dが形成されている。10

【0027】

下延出部31Cの下側部は、貫通孔24eに貫通されており、第4Oリング3Dにより上下方向への移動時に径方向の移動を抑制する。第4Oリング3Dは、操作エアが操作エア導入室21cから漏れるのを防止する。下延出部31Cには、下方に開口する装着穴31eが形成されている。

【0028】

コイルばね32は、上ケーシング25の下面とピストン31の基部31Aの上面の間に配置されており、ピストン31を常に下側に付勢している。20

【0029】

作動部33は、倍力機構収容室21b内に配置され、円柱部33Aと、円錐台部33Bとを備える。円柱部33Aは、下延出部31Cの装着穴31eに装着されている。円錐台部33Bは、下側にテーパとなるように円柱部33Aの下端に設けられている。

【0030】

図2に示すように、倍力機構40は、一対のリテーナ41(図2においては一つのみ図示)と、一対のリテーナ41間に設けられ一対のリテーナ41に支持される一対の伝達部42とを備える。

【0031】

一対のリテーナ41は、下ケーシング24に固定され、それぞれ図1の紙面に対し垂直な方向において、一対の伝達部42を挟むように設けられている。各リテーナ41には、軸受41Aが設けられている。30

【0032】

各伝達部42は、一対の支持板43と、上ローラ44と、支持軸45と、下ローラ46と、支持軸47と、偏心軸48とにより構成される。

【0033】

各支持板43は、リテーナ41に隣接して設けられている。各支持板43の上側部には円形の軸挿入孔43aが形成され、各支持板43の下側部には被嵌込孔43bが形成されている。被嵌込孔43bは、円形の上下端部が切り取られた形状をなしている。

【0034】

上ローラ44は、図1の紙面に対し垂直な方向に延びる支持軸45に対し回転可能に支持されている。支持軸45の両端は、一対の支持板43の軸挿入孔43aに挿入されている。上ローラ44は、作動部33の円錐台部33Bのテーパ面33Cに当接可能な位置に設けられる。40

【0035】

下ローラ46は、図1の紙面に対し垂直な方向に延びる支持軸47に対し回転可能に支持されている。支持軸47の両端であって、下ローラ46より突出する部分には、嵌込部47Aが設けられている。下ローラ46は、円板部19Bの上面に当接可能な位置に設けられる。嵌込部47Aは、支持軸47の上下端部を切り取った形状をなしている。各嵌込部47Aは、支持板43の被嵌込孔43bに嵌め込まれ支持板43に対し固定されている50

【0036】

偏心軸48は、嵌込部47Aに対して、支持軸47の軸心から円錐台部33Bの中心軸側に偏心した位置に設けられている。各偏心軸48は、リテーナ41の軸受41Aに装着されている。これにより、各伝達部42は、リテーナ41に対し、偏心軸48を中心に揺動可能に設けられる。

【0037】

そして、各伝達部42が揺動することにより、偏心軸48の軸心から、下ローラ46と円板部19Bとの接点までの距離が変化する。これにより、下ローラ46が円板部19Bを押圧する力が変化する。

【0038】

図1に示すようにバルブ1が閉状態にある場合には、作動部33は、コイルばね32により下方に付勢されて、最下端に位置している。これにより、各上ローラ44は、互いに遠ざかる側に位置し、各下ローラ46は、互いに近づく側に位置する。コイルばね32の付勢力は、上ローラ44、支持板43、および下ローラ46を介して、第3ステム19の円板部19Bに伝達され、第3ステム19、第2ステム18、および第1ステム17からなるステム16を下向きに付勢する。ステム16が、ダイヤフラム押さえ15を押圧することにより、ダイヤフラム13が押圧されて、弁座2Dに当接し、流入路2bと流出路2cとの連通が遮断される。

【0039】

第3ステム19の円板部19Bにかかる力は、作動部33の円錐台部33Bのテーパ角度、偏心軸48の軸心と上ローラ44の支持軸45の軸心との間の距離、および下ローラ46の支持軸47の軸心と偏心軸48の軸心との水平距離を適切な値にすることにより、コイルばね32の付勢力よりも大きくすることができます。当該原理について図3を参照して説明する。

【0040】

図3に示すように、作動部33にかかるコイルばね32の付勢力をFとし、作動部33の円錐台部33Bのテーパ面33Cの傾斜角の半角を θ とすると、作動部33から一方の上ローラ44に働く力Gは、 $G = F / 2 \sin \theta$ となる。

【0041】

この力Gは、支持板43および下ローラ46を介して、第3ステム19の円板部19Bに伝達される。

【0042】

上ローラ44の支持軸45の軸心と下ローラ46の偏心軸48の軸心との間の距離をC、上ローラ44の支持軸45の軸心と下ローラ46の偏心軸48の軸心とを結ぶ線と作動部33のテーパ面33Cとのなす角度を α 、下ローラ46の支持軸47の軸心と下ローラ46の偏心軸48の軸心との水平距離を b 、一方の下ローラ46から第3ステム19の円板部19Bに伝達される力をNとすると、 $N \times b = G \times C \cos \alpha \times C$ が成立する。よって、一対の下ローラ46が第3ステム19の円板部19Bを押す下向きの力、すなわちステム16を押す下向きの力は、 $2N = F \times C \cos \alpha \times C \div \sin \theta$ となる。 α 、 b およびCを適切な値とすることにより、任意の増幅率により作動部33にかかる力をステム16に増幅して伝達することができる。

【0043】

本実施形態では、 $\alpha = 40^\circ$ 、 $b = 25^\circ$ 、 $C = 12.5$ 、 $F = 1.5$ とすることにより、増幅率は約12倍となっている。このため、バルブ1を高圧の流体でも使用することができる。

【0044】

操作エアを、操作エア流入路25bおよび操作エア導入路31dを介して、操作エア導入室21cに導入することにより、ピストン31に対し空気圧による上向きの力が働く。この力を、コイルばね32の付勢力よりも大きくすることにより、ピストン31および作動部33は上側に移動する。これに伴い、各上ローラ44は互いに近づく側に移動して、

10

20

30

40

50

支持板 4 3 が揺動し、各下ローラ 4 6 は、互いに遠ざかる側に移動する。この結果、下ローラ 4 6 の偏心軸 4 8 の軸心から下ローラ 4 6 と円板部 1 9 Bとの接点までの距離が小さくなり、下ローラ 4 6 がステム 1 6 を下向きに押す力がなくなる。これにより、ダイヤフラム 1 3 が流体の圧力により押し上げられ、弁座 2 D から離間し、弁が開かれる（図 4 参照）。

【0045】

弁を開けるために必要な空気圧は、コイルばね 3 2 の付勢力よりもわずかに大きければ十分であり、コイルばね 3 2 の付勢力は図 3 に示した増幅原理に基づいて、小さくできるものであるから、弁を開けるために必要な空気圧は小さくてよい。

【0046】

また、本実施形態のバルブ 1 は、ナット 2 2 を緩めて、アクチュエータ部 2 0 のケーシング 2 1 を回動させることにより、駆動部 3 0 のダイヤフラム 1 3 からの距離が変化する。この結果、駆動部 3 0 による第 1 ステム 1 7 、第 2 ステム 1 8 の移動量が変化し、ダイヤフラム 1 3 のリフト量が変化する。ここで、ダイヤフラム 1 3 のリフト量とは、バルブ 1 の開閉時のダイヤフラム 1 3 の変位量である。このように、本実施形態のバルブ 1 は、アクチュエータ部 2 0 をボンネット 1 1 に対し回動させることにより、ダイヤフラム 1 3 のリフト量を調整することができる。例えば、ケーシング 2 1 をボンネット 1 1 に対し 1 回転させることにより、ケーシング 2 1 が、1 mm 上または下へ移動するように構成されている。

【0047】

また、本実施形態のバルブ 1 は、アクチュエータ部 2 0 を着脱可能に構成されている。すなわち、図 5 に示すように、ナット 2 2 を緩めて、ケーシング 2 1 を回動させて、アクチュエータ部 2 0 をボンネット 1 1 から外すことにより、他のアクチュエータ部に交換することができる。なお、本実施形態では、ステム 1 6 の第 3 ステム 1 9 は、ケーシング 2 1 に支持されているので、第 3 ステム 1 9 はアクチュエータ部 2 0 と共に交換される。

【0048】

例えば、図 6 に示すような 手動式のアクチュエータ部 5 0 に交換可能である。アクチュエータ部 5 0 は、ケーシング 5 1 と、ナット 5 2 と、駆動部 5 3 とを備える。

【0049】

ケーシング 5 1 は、略円筒状をなし、その下部の内周面に雌ねじ部 5 1 A が形成され、その上部の内周面に雌ねじ部 5 1 B が形成されている。ケーシング 5 1 の雌ねじ部 5 1 A がボンネット 1 1 の雄ねじ部 1 1 A に螺合されることにより、ケーシング 5 1 はボンネット 1 1 に固定されている。第 3 ステム 1 9 は、ケーシング 5 1 に対し上下方向に移動可能に支持されている。

【0050】

ナット 5 2 は、ケーシング 5 1 の下側において、ボンネット 1 1 の雄ねじ部 1 1 A に螺合されている。

【0051】

駆動部 5 3 は、伝達部 5 4 と、ハンドル 5 5 とを備える。

【0052】

伝達部 5 4 は、雄ねじ部 5 4 A を有し、雄ねじ部 5 4 A は、ケーシング 5 1 の雌ねじ部 5 1 B と螺合している。これにより、伝達部 5 4 は、ケーシング 5 1 に対し、回転可能かつ回転に伴い上下方向に移動可能に支持されている。伝達部 5 4 の下端は、第 3 ステム 1 9 の上端に当接している。

【0053】

ハンドル 5 5 は、伝達部 5 4 の上端に取り付けられており、作業者が手動でハンドル 5 5 を回転させ駆動力を発生させることにより、伝達部 5 4 が回転駆動力を受けて回転し上下方向に沿って移動する。伝達部 5 4 の移動に伴い、ステム 1 6 も上下方向に沿って移動し、ダイヤフラム 1 3 による弁座 2 D に対する当接および離間が行われる。

【0054】

10

20

30

40

50

また、図7に示すような 手動式および自動式の両方の機能を備えたアクチュエータ部60に交換可能である。

【0055】

アクチュエータ部60は、ケーシング61と、ナット62と、駆動部63とを備える。

【0056】

ケーシング61は、連結ケーシング61Aと、下ケーシング61Bと、上ケーシング61Cと、蓋ケーシング61Dとを備える。ケーシング61は、全体として略円筒状をなしている。連結ケーシング61Aと、下ケーシング61Bと、上ケーシング61Cとは、螺合により互いに接続されている。

【0057】

連結ケーシング61Aの下部の内周面には、雌ねじ部61Eが設けられ、当該雌ねじ部61Eがボンネット11の雄ねじ部11Aに螺合されることにより、連結ケーシング61Aはボンネット11に固定されている。第3システム19は、連結ケーシング61Aに対し上下方向に移動可能に支持されている。上ケーシング61Cの上部の内周面には、雌ねじ部61Fが設けられている。上ケーシング61Cには、操作エア導入部61Gが設けられている。蓋ケーシング61Dは、上ケーシング61Cに対し嵌め込まれている。

【0058】

ナット62は、ケーシング61の下側において、ボンネット11の雄ねじ部11Aに螺合されている。

【0059】

駆動部63は、下ピストン64と、上ピストン65と、コイルばね66と、仕切部67と、伝達部68と、ハンドル69と、を備える。

【0060】

下ピストン64は、略円筒状をなし、下ケーシング61Bに上下方向に移動可能に支持され、下端は第3システム19の上面に当接可能に構成されている。下ピストン64には、第1連通路64aおよび第2連通路64bが形成されている。下ピストン64と下ケーシング61Bとにより第1導入室64cが形成される。

【0061】

上ピストン65は、略円筒状をなし、上ケーシング61Cに上下方向に移動可能に支持されている。下ピストン64の上端は、上ピストン65の下面に当接している。上ピストン65はコイルばね66により常に下方に向かって付勢されている。

【0062】

仕切部67は、環状をなし、下ピストン64と上ピストン65との間に設けられている。仕切部67と、上ピストン65と、上ケーシング61Cとにより、第2導入室67aが形成されている。

【0063】

伝達部68は、略円柱状をなし、上ケーシング61Cの上端から連結ケーシング61Aまで延びている。伝達部68の上端には、雄ねじ部68Aが設けられている。雄ねじ部68Aは、上ケーシング61Cの雌ねじ部61Fに螺合し、これにより、伝達部68は、上ケーシング61Cに対し、回転可能かつ回転に伴い上下方向に移動可能に支持されている。伝達部68の下端は、第3システム19の上端に当接している。

【0064】

伝達部68には、その軸方向に沿って延びる軸通路68bと、軸通路68bに連通し伝達部68の径方向に延びる第1径通路68cおよび第2径通路68dとが形成されている。また、伝達部68の外周であって、下ピストン64に対向する部分の一部は、外径が僅かに小さく構成されており、下ピストン64との間に操作エアが通る隙間が形成されている。軸通路68bの上端には、その開口を塞ぐ閉止球68Eが設けられている。

【0065】

ハンドル69は、伝達部68の上端に取り付けられており、作業者が手動でハンドル69を回転させ駆動力を発生させることにより、伝達部68が回転駆動力を受けて回転し上

10

20

30

40

50

下方向に沿って移動する。

【0066】

図7に示す状態では、伝達部68および下ピストン64が最も下側に位置して、ステム16を下方に押圧し、バルブ1は閉状態にある。この状態で、ハンドル69を回転させて、伝達部68を上方へ移動させると、伝達部68の下端は、第3ステム19の上面から離間する。下ピストン64および上ピストン65は、コイルばね66により下方に付勢され、下ピストン64が第3ステム19を下方に押圧しているので、ダイヤフラム13は弁座2Dに当接したままである。

【0067】

操作エア導入部61Gから操作エアを導入し、第1径通路68c、軸通路68b、第2径通路68dを介して、第2導入室67aに操作エアを導入させる。これにより、上ピストン65はコイルばね66の付勢力に抗して上昇する。さらに、操作エアは、伝達部68と下ピストン64との間の隙間および第2連通路64bを通過して第1導入室64cに導入され、上ピストン65が上昇しているので下ピストン64は上昇する。この結果、下ピストン64も、第3ステム19の上面から離間するので、ステム16を下向きに押す力がなくなり、ダイヤフラム13が流体の圧力により押し上げられ、弁座2Dから離間する。この場合、アクチュエータ部60の駆動部63は自動式の駆動部63として機能する。

【0068】

また、操作エア導入部61Gから操作エアを導入し、下ピストン64を第3ステム19から離間させた状態において、ハンドル69を回動させて、伝達部68を上下動させる。伝達部68が上下動することにより、ステム16が上下方向に沿って移動し、ダイヤフラム13による弁座2Dに対する当接および離間が行われる。この場合、アクチュエータ部60の駆動部63は、手動式の駆動部63として機能する。

【0069】

このように、アクチュエータ部60の駆動部63は、手動式および自動式の両方の機能を備えている。

【0070】

以上のように、本実施形態のバルブ1によれば、ステム16は、上下方向（ボンネット11が延びる方向）に沿って複数に分割して構成され、ナット22を緩めて、アクチュエータ部20のケーシング21をボンネット11に対して回動させることにより、駆動部30のダイヤフラム13からの距離が変化すると共にステム16の移動量が変化し、ダイヤフラム13のリフト量が変化するように構成されている。

【0071】

かかる構成によれば、ダイヤフラム13のリフト量調整のためにアクチュエータ部20のケーシング21を回転させたとしても、ステム16が複数に分割されているので、ケーシング21の回転がダイヤフラム13まで伝達されることはないので、ダイヤフラム13を傷つけることなくダイヤフラム13のリフト量を調整することができる。

【0072】

また、ステム16が複数に分割されているので、バルブ1を高温で使用したとしても、アクチュエータ部20へ熱の伝達を抑制することができる。また、バルブ1を高温仕様とするため、ボンネット11を長くし、ステム16が全体として長くなつたとしても、ステム16を複数に分割して構成しているので、ステム16の寸法精度を容易に出すことができる。

【0073】

また、駆動部30が駆動していない状態では、バルブ1は、コイルばね32の付勢力によりダイヤフラム13が押圧されて弁座2Dに当接し、流入路2bと流出路2cとの連通が遮断された閉状態にある。よって、ダイヤフラム13のリフト量調整を安全に実行することができる。

【0074】

また、ステム16をダイヤフラム13に向かって付勢するコイルばね32は、アクチュ

10

20

30

40

50

エーテ部 20 内に設けられている。よって、コイルばね 32 をボディ 2 から遠ざけることができる。熱により、コイルばね 32 が熱膨張して、バネ定数が変動し、ステム 16 およびダイヤフラム 13 のリフト量が変化するのを抑制することができる。

【 0 0 7 5 】

また、本実施形態のバルブ 1 によれば、ステム 16 は、上下方向（ポンネット 11 が延びる方向）に沿って複数に分割して構成され、ステム 16 を駆動するアクチュエータ部 20 は、ステム 16 をダイヤフラム 13 に向かって付勢するコイルばね 32 と、ポンネット 11 に対し着脱可能に係止するナット 22 とを備える。

【 0 0 7 6 】

かかる構成によれば、流体通路の気密性を確保したまま、アクチュエータ部 20 の交換を容易に行うことができる。また、ステム 16 をダイヤフラム 13 に向かって付勢するコイルばね 32 はアクチュエータ部 20 内に設けられているので、ステム 16 は複数に分割して構成されていても、流体の圧力によりダイヤフラム 13 を押し上げて流体通路を開状態にすることができる。

【 0 0 7 7 】

また、自動式の駆動部 30 を備えたアクチュエータ部 20 は、図 6 に示した手動式の駆動部 53 を備えたアクチュエータ部 50 に、図 7 に示した手動式および自動式の両方の機能を備えた駆動部 63 を備えたアクチュエータ部 60 に交換可能である。よって、バルブ 1 をラインに施工した状態で、種々のアクチュエータ部の変更を容易に行うことができる。
。

【 0 0 7 8 】

なお、本発明は、上述した実施例に限定されない。当業者であれば、本発明の範囲内で、種々の追加や変更等を行うことができる。

【 0 0 7 9 】

例えば、上記の実施形態において、アクチュエータ部 20 の駆動部 30 には、倍力機構 40 が設けられていたが、倍力機構 40 がない駆動部であっても良い。バルブ 1 のアクチュエータ部 20 の構成は、ノーマルクローズであったが、ノーマルオープンであっても良い。すなわち、高圧対応でありノーマルクローズのアクチュエータ部 20 を、高圧対応でないアクチュエータ部またはノーマルオープンのアクチュエータ部に交換可能である。

【 0 0 8 0 】

また、ステム 16 は、3 つに分割されていたが、分割された構成であれば何個に分割されていても良い。また、上記の実施形態では、バルブ 1 は、流体制御装置のガスラインに使用される形態のものを示したが、バルブ 1 の形態はこれに限らない。

【 符号の説明 】

【 0 0 8 1 】

- 1 : バルブ
- 2 : ボディ
- 2 a : 弁室
- 2 b : 流入路
- 2 c : 流出路
- 2 D : 弁座
- 1 1 : ポンネット
- 1 3 : ダイヤフラム
- 1 6 : ステム
- 1 7 : 第 1 ステム
- 1 8 : 第 2 ステム
- 1 9 : 第 3 ステム
- 2 0、5 0、6 0 : アクチュエータ部
- 2 1、5 1、6 1 : ケーシング
- 2 2、5 2、6 2 : ナット

10

20

30

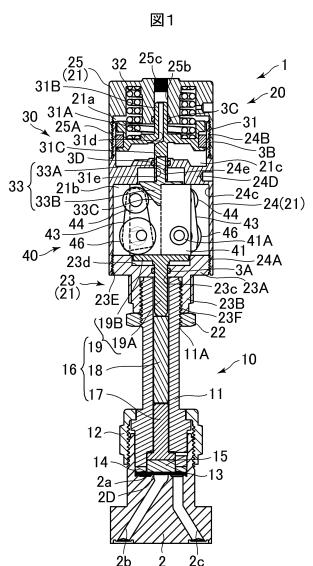
40

50

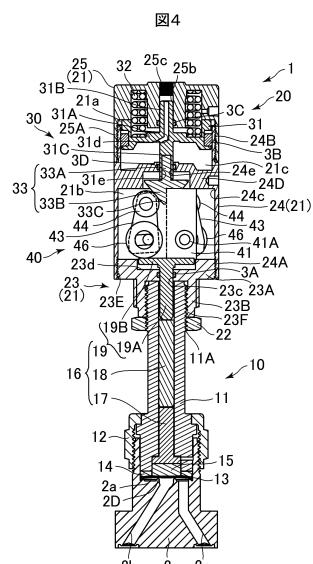
30、53、63：駆動部

32：コイルばね

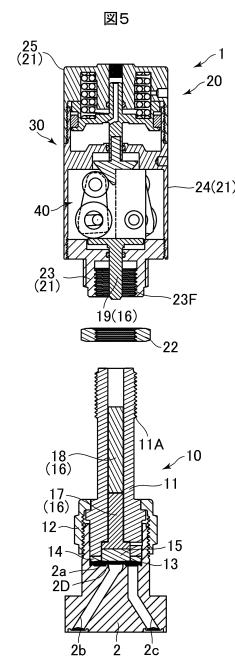
【図1】



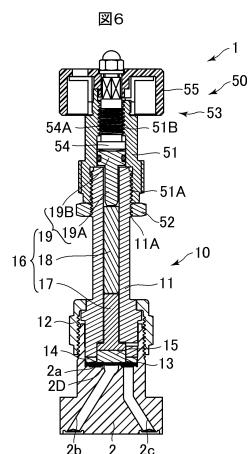
【 四 4 】



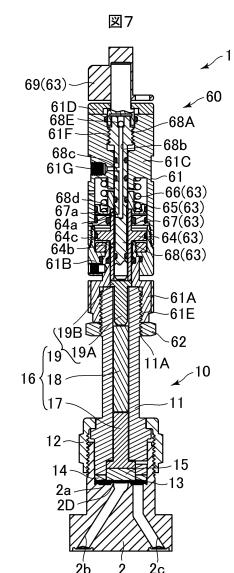
【図5】



【 四 6 】



【図7】



フロントページの続き

(72)発明者 山路 道雄
大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番2号 株式会社フジキン内
(72)発明者 谷川 賢
大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番2号 株式会社フジキン内
(72)発明者 石橋 圭介
大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番2号 株式会社フジキン内

審査官 所村 陽一

(56)参考文献 特開平03-157577(JP,A)
特開2007-064333(JP,A)
特開2007-046725(JP,A)
特開2001-295948(JP,A)
国際公開第2015/020209(WO,A1)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

F 16 K 7 / 16
F 16 K 27 / 12
F 16 K 31 / 524